

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 1 区分

【発行日】平成31年2月28日 (2019.2.28)

【公開番号】特開2018-184343(P2018-184343A)

【公開日】平成30年11月22日 (2018.11.22)

【年通号数】公開・登録公報2018-045

【出願番号】特願2018-116932(P2018-116932)

【国際特許分類】

C 0 4 B 35/64 (2006.01)

C 0 4 B 38/06 (2006.01)

B 0 1 D 39/20 (2006.01)

【F I】

C 0 4 B 35/64

C 0 4 B 38/06 B

B 0 1 D 39/20 D

【手続補正書】

【提出日】平成31年1月15日 (2019.1.15)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

キルン中で未焼結コージエライトハニカムセラミック体を焼成するための方法において、前記方法が、

a) 室温から、3 7 5 ~ 5 0 0 の範囲にある第一の温度まで、9 0 / 時間 ~ 1 2 5 / 時間の範囲にある第一の加熱速度で、前記未焼結コージエライトハニカムセラミック体を加熱する工程と、

b) 前記第一の温度から、7 5 0 ~ 8 5 0 の範囲にある第二の温度まで、2 0 / 時間 ~ 7 5 / 時間の範囲にある第二の加熱速度で、前記未焼結コージエライトハニカムセラミック体を加熱する工程と、

c) 前記第二の温度から、9 5 0 ~ 1 1 0 0 の範囲にある保持温度まで、前記第二の加熱速度以下である第三の加熱速度で、前記未焼結コージエライトハニカムセラミック体を加熱する工程と、

d) 前記保持温度で前記未焼結コージエライトハニカムセラミック体を保持して残留炭素を除去する工程と、

を有してなり、前記未焼結コージエライトハニカムセラミック体が、9 インチ (23 cm) ~ 12 インチ (30 cm) の範囲の直径と、0 . 7 5 ~ 1 . 5 0 の範囲のアスペクト比を有するものであることを特徴とする、方法。

【請求項 2】

前記第三の加熱速度が 2 0 / 時間 ~ 5 0 / 時間の範囲にあることを特徴とする、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

工程 a) における酸素レベルをキルン雰囲気中の 4 体積 % ~ 15 体積 % の範囲に調整することを更に含むことを特徴とする、請求項 1 又は 2 に記載の方法。

【請求項 4】

工程 d) における酸素レベルをキルン雰囲気中の 7 体積 % ~ 12 体積 % の範囲に調整する

ことを特徴とする、請求項 1 から 3 いずれか 1 項に記載の方法。

【請求項 5】

工程 a ) ~ 工程 c ) において蒸気を前記キルン中に導入することを更に含み、工程 a ) ~ 工程 c ) における蒸気量がキルン雰囲気中の 30 % 未満であることを特徴とする、請求項 1 から 4 いずれか 1 項に記載の方法。